

## Альтами МЕТ 3Т микроскоп для микроэлектроники



### Цена:

Цена по запросу

### Описание

Методы контрастирования в отраженном свете:

- светлое поле;
- темное поле;
- поляризация.

Увеличение (доступные значения):	50X-1600X (50X, 80X*, 100X, 160X*, 200X, 320X*, 400X, 500X, 600X*, 640X*, 800X, 960X*, 1000X, 1200X*, 1280X*, 1600X, 2000X*).
Окуляры:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WF10X/22 мм;</li> <li>• WF10X/22 мм с перекрестием и шкалой (100 делений);</li> <li>• WF16X/15 мм*;</li> <li>• WF20X/12 мм.</li> </ul>

<p>Эпи-план ахроматические объективы для светлого и темного поля с увеличенными рабочими расстояниями, скорректированные «на бесконечность» (ICCOS L PLAN):</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PL L 5X/0.12 BD <math>\infty</math>/- (рабочее расстояние 9.7 мм);</li> <li>• PL L 10X/0.25 BD <math>\infty</math>/0 (р. р. 9.3 мм);</li> <li>• PL L 20X/0.40 BD <math>\infty</math>/0 (р. р. 7.2 мм);</li> <li>• PL L 40X/0.60 BD <math>\infty</math>/0 (р. р. 3.0 мм) (подпружиненный)*;</li> <li>• PL L 50X/0.70 BD <math>\infty</math>/0 (р. р. 2.5 мм) (подпружиненный);</li> <li>• PL L 60X/0.70 BD <math>\infty</math>/0 (р. р. 1.9 мм) (подпружиненный)*;</li> <li>• PL L 80X/0.80 BD <math>\infty</math>/0 (р. р. 1.2 мм) (подпружиненный);</li> <li>• PL L 100X/0.85 BD <math>\infty</math>/0 (р. р. 0.2 мм) (подпружиненный)*.</li> </ul>
<p>Насадка:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• тринокулярная с наклоном 30°;</li> <li>• отдельный выход для подключения устройств захвата изображения;</li> <li>• диоптрийная подстройка <math>\pm 5</math> диоптрий;</li> <li>• изменяемое межзрачковое расстояние 53-75 мм.</li> </ul>

<p>Освещение:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• система освещения Epi-Kohler с регулируемыми апертурной и полевой диафрагмами;</li> <li>• колесо со светофильтрами (синий, зеленый, желтый, матовый);</li> <li>• источник освещения галогенная лампа, 12 В/50 Вт;</li> <li>• возможность комплектации LED осветителем для полупрозрачных объектов.</li> </ul>
<p>Предметный столик:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• прямоугольный двухкоординатный 280x270 мм;</li> <li>• диапазон перемещений 204x204 мм.</li> </ul>
<p>Фокусировка:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• коаксиальные винты грубой и точной фокусировки;</li> <li>• встроенный механизм для защиты объекта и объектива при быстрой смене;</li> <li>• регулировка жесткости хода;</li> <li>• шаг точной фокусировки 0.008 мм.</li> </ul>

Цифровая камера:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• цветная CMOS 3 Мпикс (возможно укомплектовать другой камерой на выбор).</li> </ul>
Программное обеспечение:	Altami Studio — программа для управления устройствами захвата изображения с возможностью проведения измерений, анализа и обработки изображений как на статичном изображении, так и на видеопотоке с камеры в онлайн-режиме.

## Основные достоинства

- Предназначен для работы в отраженном свете, в светлом и темном поле, а также по методу простой поляризации
- Эпи-план ахроматические объективы для светлого и темного поля с увеличенными рабочими расстояниями, скорректированные «на бесконечность» (ICCOS L PLAN): 5X/0.17, 10X/0.25, 20X/0.40, 50X/0.70, 80X/0.8
- Большой удобный стол размерами 280×270 мм и диапазоном перемещений 204 x 204 мм — отличный инструмент для работы с кварцевыми пластинами, интегральными микросхемами и печатными платами больших размеров
- Возможность установки светодиодного осветителя для работы с полупрозрачными объектами
- Укомплектован цифровой камерой и программным обеспечением с функциями измерений объектов интереса, получения панорамного изображения и др